

△×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>QUANTITY</u> 個数	
△×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—		<u>FINISHING</u> 仕上		—		—	
△×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—			
△×						~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	<u>ANGLE</u> 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用（機種名）				
△×2	rotation・Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.	DESIGNED	DRAWN	~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~					—		V S - T C T 0 8 - 6 5 C 0 / S				
△×1	形状変更	16.08.23	T. T.	T. A.	T. T.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~				SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図				
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~							DATE	15.10.06	DRAW NO.	0 D T C 0 5 4 9 A 3	
						<u>TOLERANCES</u>				A	B	C	S				